



Torino, 12 settembre 2019

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di un sistema Inductively Coupled Plasma Chemical Vapor Deposition (ICPCVD)

CIG 796950211A - CID 321-15 - CUP E15D18000350007 - CUI F00518460019201900102

Convocazione II Seduta pubblica

Si comunica che il giorno **17 settembre 2019 alle ore 10:00 presso la Saletta B del Rettorato**, sita al primo piano dell'Ateneo in C.so Duca degli Abruzzi, 24 – Torino, si terrà la seconda seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto nel corso della quale il Seggio di Gara provvederà a formulare la proposta di ammissione dei Concorrenti partecipanti.

Ufficio Appalti